Спонтанное и вынужденное излучение эксимерных молекул XeCl* при накачке газовых смесей Xe-CCl₄ и Ar-Xe-CCl₄ с низким содержанием CCl₄ быстрыми электронами и осколками деления урана

А.И.Миськевич, Цзиньбо Го, Ю.А.Дюжов

Приведены результаты экспериментальных исследований спонтанного и вынужденного излучений эксимерных молекул XeCl^{*} при возбуждении газовых смесей Xe-CCl₄ и Ar-Xe-CCl₄ с низким содержанием CCl₄ заряженными частицами высокой энергии – импульсным пучком быстрых электронов и продуктами нейтронной ядерной реакции ²³⁵U(n, f). Энергия электронов равнялась 150 кэВ, длительность и амплитуда импульса тока накачки – 5 нс и 5 A. Энергия осколков деления не превышала 100 MэB, длительность нейтронного импульса накачки – 200 мкс, удельная мощность энерговклада в газ – около 300 Bm/см³. При накачке электронным пучком в кювете длиной 4 см в резонаторе с пропусканием выходного зеркала 2.7% реализуется режим генерации лазерного излучения на $B \rightarrow X$ -переходе молекулы XeCl^{*} ($\lambda =$ 308 нм) с коэффициентом усиления с = 0.0085 см⁻¹ и эффективностью флуоресценции иа B-X-переходе $\eta \approx 10\%$, а при накачке осколками деления в кювете длиной 250 см в резонаторе, образованном глухим зеркалом и кварцевым окном, – режим усиленного спонтанного излучения (УСИ) с выходной мощностью излучения 40–50 кВт/ср и длительностью импульса УСИ по основанию ~200 мкс.

Ключевые слова: активная среда, эксимер, люминесценция, XeCl*, ядерная накачка.

1. Введение

Лазеры с ядерной накачкой работают при низких удельных энерговкладах в газ, обычно менее 10⁴ Вт/см³. Их высокие энергетические характеристики достигаются за счет большой длительности импульса накачки (от нескольких сотен микросекунд вплоть до непрерывного режима работы) и возможности возбуждения большого (до нескольких кубических метров) объема активной среды [1]. Полученный в настоящее время удельный энергосъем лазерного излучения при ядерной накачке составляет 32 Дж/л за импульс длительностью 200 мкс при эффективности $\eta \sim 3\%$ от вложенной в газ энергии продуктов ядерной реакции [2]. Рабочие характеристики таких лазеров могут быть улучшены при использовании сред с высокой квантовой эффективностью лазерного перехода, которой обладают, например, галоидосодержащие эксимерные молекулы инертных газов. Молекула XeCl* относится к таким молекулам – для нее квантовая эффективность В-Х-перехода ($\lambda = 308$ нм) составляет ~27%. Целью настоящей работы является выяснение возможности использования эксимерных молекул XeCl* в качестве рабочей среды лазеров с ядерной накачкой.

Излучательное время жизни В-состояния XeCl^{*} равно 11 нс, полуширина полосы излучения – 1.4 нм [3,4]. Глубина потенциальной ямы X-состояния составляет около 30 мВ [5], что сравнимо с энергией теплового движения ато-

Поступила в редакцию 29 января 2013 г, после доработки – 31 мая 2013 г.

мов. В связи с этим инверсная населенность уровней для В–Х-переходов молекулы XeCl^{*} должна существовать уже при очень низких уровнях накачки. Однако результаты экспериментальных работ показывают, что вынужденное излучение на переходах молекулы XeCl^{*} возникает при очень высоких уровнях накачки, составляющих 0.3–3 MBT/см³ [6–8]. Это может быть вызвано большой шириной верхнего уровня лазерного перехода, низкой эффективностью его возбуждения и высокими внутрирезонаторными потерями.

Наиболее эффективным хлорсодержащим донором для образования эксимерных молекул XeCl^{*} и Xe₂Cl^{*} является четыреххлористый углерод CCl₄ [9]. В работе [10] было показано, что эффективности возбуждения В-состояния молекулы XeCl^{*} и 4²Г-состояния молекулы Xe₂Cl^{*} сильно зависят от парциального давления галогенсодержащего донора CCl₄ в смеси, возрастая многократно при низких (30–50 мТор) давлениях. В таких газовых смесях (с низким содержанием CCl₄) усиление вынужденного излучения было зарегистрировано во всей полосе $4^2\Gamma - 1,2,3^2\Gamma$ эксимерной молекулы Xe₂Cl^{*} шириной $\Delta \lambda = 90$ нм при удельной мощности энерговклада в газ около 7 кВт/см³ в лазерной кювете длиной 4 см при накачке пучком электронов с энергией 150 кэВ [11].

В настоящей работе сообщается о получении низкопороговой квазинепрерывной генерации лазерного излучения на B–X-переходах молекулы XeCl^{*} при накачке газовых смесей Xe–CCl₄ и Ar–Xe–CCl₄ с низким содержанием CCl₄ частицами с высокой энергией. Газовые смеси возбуждались импульсным пучком быстрых электронов при удельном энерговкладе в газ менее 10 кBт/см³ ($E_e = 150$ кэВ, ток пучка 5 А, длительность 5 × 10⁻⁹ с) и продуктами нейтронной ядерной реакции ²³⁵U(n, f) с энергией ~100 МэВ (осколки деления урана-235) при удельном энерговкладе в газ ~300 Вт/см³ и длительности нейтронного импульса накачки около 200 мкс.

А.И.Миськевич, Цзиньбо Го, Ю.А.Дюжов. Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Россия, 115409 Москва, Каширское ш., 31; e-mail: miskev@mail.ru, hellogjb@yahoo.com.cn, yu.dyuz@gmail.com

2. Экспериментальная установка

Исследования с электронным пучком проводились на установке, схема которой представлена на рис.1. Газовые смеси Xe-CCl₄ и Ar-Xe-CCl₄ различного состава (Ar -1140 Тор, Хе – от 10 до 150 Тор, CCl₄ – от 0.038 до 2 Тор) напускались в кювету І из нержавеющей стали (ø110 × 130 мм) с двумя фланцами 2 на боковой поверхности для установки кварцевых окон или лазерных зеркал (ø40 × 10 мм). На нижнем торце кюветы была установлена импульсная трубка ИМА-150Э 3 с взрывоэмиссионным катодом, формирующая импульсный пучок быстрых электронов с энергией 150 кэВ и длительностью ~5 нс на полувысоте. Пучок вводился в кювету перпендикулярно оптической оси резонатора, длина возбуждаемой активной среды лазера составляла ~4 см. На рис.2 показаны измеренная с помощью плоского зонда форма импульса тока пучка электронов накачки, вводимого в кювету, и пространственное распределение плотности тока пучка электронов на оси резонатора в момент действия импульса накачки. Из-за сильной поперечной и продольной неоднородностей пучка и большого пробега электронов с энергией 150 кэВ в газовой смеси, превышающего поперечные размеры активной среды лазера, удельный энерговклад в активную среду лазера составил менее 10 кВт/см³ для импульса накачки длительностью 5 нс.

На боковых фланцах кюветы 2 устанавливались два кварцевых окна или два узкополосных сферических зеркала на кварцевой подложке с многослойными диэлектрическими покрытиями, имеющие высокий коэффициент отражения ($\rho_1 = 99.8\%$ и $\rho_2 = 97.3\%$) на длине волны 308 нм. При соответствующей юстировке эти зеркала могли образовывать оптический резонатор. Кварцевые окна использовались при измерениях спектральных и временных характеристик спонтанного излучения газовых смесей Xe-CCl₄ и Ar-Xe-CCl₄. На верхней крышке кюветы имелось третье кварцевое окно 4, через которое при работе лазера можно было регистрировать спонтанное излучение газовой смеси с помощью спектрометра МАYA-2000Pro 5 с ПЗС-матрицей.

Запись временных сигналов производилась быстрым цифровым осциллографом RIGOL DS 5022ME 6 с помо-



Рис.1. Схема экспериментальной установки:

I – камера; 2 – фланец с кварцевым окном или зеркалом; 3 – импульсная трубка ИМА-150Э; 4 – верхнее кварцевое окно; 5 – спектрометр МАҮА-2000Рго; 6 – цифровой осциллограф RigolDS5022;
 7 – фотоумножитель ФЭУ-106 (ФЭУ-62); 8 – монохроматор МДР-23;
 9 – циркуляционный насос; 10 – титановый фильтр; 11 – компьютер IBM PC; 12 – волоконный кварцевый световод с входной линзой;
 13 – ускоритель электронов «Арина-2».



Рис.2. Осциллограмма импульса тока *I* пучка электронов накачки, вводимого в кювету (*a*), и пространственное распределение плотности тока *J* пучка электронов вдоль оси кюветы в момент действия импульса накачки (*б*). Штриховая линия – усредненные значения плотности тока пучка электронов накачки на оси лазера (*l* = 4 см).

щью фотоумножителя ФЭУ-106 или ФЭУ-62 7, установленного на выходной щели спектрометра МДР-23 8. При проведении экспериментов особое внимание уделялось чистоте газовой смеси. Для этого перед ее окончательным приготовлением (т. е. перед напуском CCl₄) проводилась очистка ксенонсодержащего буферного газа от молекулярных примесных газов (N₂, O₂, CO₂), десорбируемых со стенок кюветы. Очистка проводилась непосредственно в кювете путем многократной прокачки газа с помощью циркуляционного насоса 9 через фильтр 10 с разогретой до 700 °C титановой губкой. Конструкция циркуляционного насоса и системы очистки газа описана в работе [12].

При накачке продуктами нейтронной ядерной реакции ²³⁵U(n, f) использовался лазерный элемент стенда Б ядерного реактора «БАРС-6» длиной 250 см, диаметром 4.8 см со слоем металлического урана-235 толщиной 5 мкм на внутренней поверхности и двумя многослойными диэлектрическими зеркалами в качестве окон [13]. Накачка лазерного элемента производилась нейтронным импульсом ядерного реактора «Барс-6» длительностью на полувысоте ~200 мкс, объем возбуждаемой активной среды составлял 4 л при удельной мощности энерговклада в газ до 300 Вт/см³. При установке или замене зеркал лазерный элемент откачивался турбомолекулярным насосом до остаточного давления 3 × 10⁻² Тор и заполнялся газом из баллона с заранее приготовленой газовой смесью без проведения операции дополнительной очистки газа. Перенаполнение лазерного элемента после каждого импульса накачки не проводилось.

3. Обсуждение результатов

Спектры спонтанного излучения газовых смесей Xe-CCl₄ и Ar-Xe-CCl₄ различного состава приведены на рис.3. В сине-зеленых областях спектров (430–650 нм) присутствует континуум, приписываемый переходам $4^{2}\Gamma$ - 1^{2} , 2^{2} , $3^{2}\Gamma$ молекулы Xe₂Cl^{*}, и относительно узкие полосы при λ = 308, 345 и 282 нм, приписываемые переходам B-X, C-A и D-X молекулы XeCl^{*}. Все спектры записаны при одинаковых условиях возбуждения газовых смесей электронным пучком.

Образование эксимерных молекул XeCl^{*} в бинарной газовой смеси Xe–CCl₄ происходит по каналу ион-ионной рекомбинации [14]

$$Xe^+ + Cl^- + (M) \rightarrow XeCl^* + (M), k_1 = 5 \times 10^{-9} \text{ cm}^{3/c}, (1)$$

и в реакции с участием молекул CCl_4 и метастабильных атомов Xe^{*}(6s ${}^{3}P_2$) [15]

$$Xe^{*}(6s^{3}P_{2}) + CCl_{4} \rightarrow XeCl^{*} + CCl_{3}, k_{2} = 8 \times 10^{-11} \text{ cm}^{3}/\text{c.}$$
 (2)

Ионы Xe⁺ и возбужденные атомы Xe^{*} образуются непосредственно первичной заряженной частицей высокой энергии при ее торможении в газовой среде. Из всех возможных возбужденных состояний атома Xe наибольшую вероятность возбуждения имеют низколежащие уровни, оптически связанные с основным состоянием атома [16]. Образование отрицательных ионов Cl⁻ происходит в реакции диссоциативного прилипания электронов низких энергий к молекуле CCl₄ [17]:

$$CCl_4 + e \to CCl_3 + Cl^-. \tag{3}$$

Собственно ионы CCl₄⁻ не образуются вследствие того, что энергия диссоциации

$$\operatorname{CCl}_4^- \to \operatorname{CCl}_3 + \operatorname{Cl}^-$$
 (4)

на 0.5 эВ меньше энергии основного состояния молекулы CCl_4^- . Электроны с большими энергиями (несколько электронвольт) при прилипании могут сильнее разрушать молекулу CCl_4 и образовывать ионы CCl_3^- , CCl_2^- , Cl_2^- [17, 18]. При энергии электронов $E_e = 0.05$ эВ, по данным работы [18], сечение их прилипания к молекулам CCl_4 равно 2.22 $\times 10^{-14}$ см². Это соответствует константе скорости прилипания $k_a \approx 2.2 \times 10^{-7}$ см³/с. При парциальном давлении галогенсодержащего донора 30 мТор время прилипания электронов составляет несколько наносекунд.

Тушение молекул XeCl^{*} в газовой смеси Xe–CCl₄ происходит при их столкновениях с молекулами CCl₄ и атомами Xe. При низких давлениях донора (менее 1 Тор) константы скоростей реакций тушения XeCl^{*} молекулами CCl₄ и атомами Xe равны 1.98 × 10⁻⁹ и 1.4 × 10⁻¹² см³/с соответственно при $p_{Xe} = 500$ Top [10]. С увеличением давления Xe возрастает скорость реакции конверсии атомарных ионов Xe⁺ в молекулярные ионы Xe²⁺ [3]:

$$Xe^+ + 2Xe \rightarrow Xe_2^+ + Xe, k_3 = 2.5 \times 10^{-31} \text{ cm}^6/\text{c.}$$
 (5)

Этот канал приводит к уменьшению концентрации ионов Xe⁺ в смеси и, следовательно, к снижению концентрации молекул XeCl^{*}, нарабатываемых в реакции (1).



Рис.3. Спектры спонтанного излучения молекул XeCl^{*} и Xe₂Cl^{*} в газовых смесях Xe-CCl₄ (a, b) и Ar-Xe-CCl₄ (s, c) различного состава при возбуждении импульсным пучком быстрых электронов с энергией 150 кэВ.

Таким образом, для эффективной работы лазера на В–Х-переходе молекулы XeCl^{*} (λ = 308 нм) с использованием бинарной газовой смеси Xe–CCl₄ в ней необходимо поддерживать низкие парциальное давление CCl₄ ($p_{CCl_4} \ll$ 1 Тор) и давление Xe ($p_{Xe} \ll 100-200$ Тор). Для увеличения энерговклада в газовую смесь с низким содержанием ксенона следует вводить буферный газ (Ne, Ar) под давлением в несколько атмосфер.

Генерационные эксперименты со смесями с низким содержанием донора CCl_4 проводились при накачке газовых смесей Xe–CCl₄ и Ar–Xe–CCl₄ маломощным импульсным пучком электронов, смесей Ar–Xe–CCl₄ – осколками деления урана-235. Использовались смеси следующего состава: Xe (152 Top)–CCl₄ (36 мTop) и Ar (1140 Top)–Xe (12.5 Top)–CCl₄ (37 мTop) при накачке пучком электронов и Ar (1000 Top)–Xe (15 Top)–CCl₄ (50 мTop) при накачке осколками деления урана-235.

3.1. Результаты экспериментов по накачке эксимерных молекул XeCl^{*} пучком быстрых электронов

Расстояние между зеркалами в лазерной кювете (см. рис.1) равнялось 19 см, при этом длина активной области лазера составляла только 4 см. Амплитудное значение плотности тока быстрых электронов на оси лазерной кюветы, усредненное по длине активной среды, было равно ~0.4 A/cm^2 (см. рис.2, δ). Входная линза волоконного световода спектрометра Maya-2000Pro размещалась на оптической оси резонатора на расстоянии 100-200 мм от выходного зеркала. Спектрометр регистрировал излучение, проходящее через выходное зеркало, при настроенном и разъюстированном резонаторе. Разрешение спектрометра составляло 1 нм. Одновременно с измерениями спектрального состава излучения с помощью осциллографа RIGOL DS 5022 ME и монохроматора МДР-23 производилась запись формы импульса излучения с длиной волны 308 нм. Полученные спектрограммы и осциллограммы приведены на рис.4 и 5.

В экспериментах была зарегистрирована низкопороговая генерация на $\lambda = 308$ нм на B-X-переходе молекулы XeCl^{*} при использовании зеркал с коэффициентами отражения 99.8% и 97.3% на $\lambda = 308$ нм и пропусканием 60%–80% в остальной части спектрального диапазона. Длительность генерации для газовых смесей Ar–Xe–CCl₄ составила ~120 нс, что значительно превышает длительность импульса накачки (5 нс) и излучательное время B-X-перехода молекулы XeCl^{*} (11 нс). Это указывает на возможность получения квазинепрерывной генерации на B-X-переходе молекулы XeCl^{*} при накачке длинным импульсом.

Осциллограммы импульса генерации (рис.5) позволяют оценить усиление активной среды. Рассматривая последовательное прохождение луча света между зеркалами в усиливающей среде, можно показать, что при условии ненасыщенного усиления амплитуды импульсов тока U_1 и U_2 , зарегистрированные фотоприемником в начальные моменты времени развития генерации t_1 и t_2 , соотносятся между собой следующим образом:

$$U_1/U_2 = (\rho_1 \rho_2)^m \exp(2m\kappa L). \tag{6}$$

Здесь ρ_1, ρ_2 – коэффициенты отражения глухого и выходного зеркал; κ – коэффициент усиления активной среды;



Рис.4. Спектры излучения с длиной волны ~308 нм в смесях Xe–CCl₄ (*a*) и Ar–Xe–CCl₄ (*б*) при настроенном (штриховые кривые) и разьюстированном (сплошные кривые) резонаторах; накачка производится импульсным пучком быстрых электронов с энергией 150 кэВ и длительностью 5 нс при удельном энерговкладе в активную среду лазера ~7 кВт/см³.

 $m = c(t_1 - t_2)/2L_0$ – число проходов светового луча между зеркалами за промежуток времени $t_1 - t_2$; L и L_0 – длина активной среды лазера и расстояние между зеркалами.

Отсюда получаем

$$\kappa = [\ln(U_1/U_2) - m\ln(\rho_1 \rho_2)]/(2mL).$$
(7)

Для условий нашего эксперимента $\rho_1 = 0.998$, $\rho_2 = 0.973$, L = 4 см, $L_0 = 19 \text{ см}$, $U_1/U_2 \approx 1.207$ (для моментов времени $t_1 = 15$ нс и $t_2 = 10$ нс от начала генерации; интервал $t_1 - t_2 = 5$ нс соответствует четырем проходам резонатора). Отсюда $\kappa = 0.0085 \text{ см}^{-1}$.

Сечение вынужденного излучения для B-Х-перехода молекулы XeCl* определяется свойствами молекулы и равно [3]

$$\sigma(308 \text{ HM}) = (1/4\pi)(\ln 2/\pi)^{0.5}A\lambda^4/(c\Delta\lambda) = 7.275 \times 10^{-16} \text{ cm}^2. (8)$$

Здесь $\lambda=3.08\times 10^{-5}$ см; $\Delta\lambda=1.4\times 10^{-7}$ см; $A=10^9/11=9.09\times 10^7$ с $^{-1}$.

Поскольку $\kappa = \sigma(308 \text{ нм})\Delta N$, можно определить инверсную населенность ΔN верхнего рабочего уровня молекулы XeCl^{*}:

$$\Delta N = \kappa / \sigma (308 \text{ HM}) = 0.0085 / 7.286 \times 10^{-16} = 1.16 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}.$$
(9)

Удельная мощность энерговклада в газовую смесь Ar-Xe-CCl₄ есть $w = I_{av}E_0/R(E_0)$, где $I_{av} = 0.4$ A/см² –



Рис.5. Осциллограммы импульсов излучения с длиной волны ~308 нм в смесях $Xe-CCl_4(a)$ и $Ar-Xe-CCl_4(b)$ при настроенном (1) и разъюстированном (2) резонаторах; накачка производится импульсным пучком быстрых электронов с энергией 150 кэВ и длительностью 5 нс при удельном энерговкладе в активную среду менее 10 кВт/см³.

усредненное значение плотности тока на оси лазерной кюветы (рис.2, δ); $E_0 = 1.56 \times 10^5$ эВ – энергия электронов пучка; $R(E_0) = 8.51$ см – пробег электрона в газовой смеси Ar-Xe-CCl₄ ($p_{Ar} = 1.5$ атм, $p_{Xe} = 12.5$ Тор, $p_{CCl_4} = 0.036$ Тор). Используя эти значения, получаем w = 7.05 кВт/см³. Отсюда эффективность флуоресценции на В–Х-переходе молекулы XeCl^{*}

$$\eta = \Delta N A h v / w = 668 / 7.05 \times 10^3 = 9.48 \%.$$
(10)

Эти экспериментальные результаты открывают возможность создания эксимерного лазера с ядерной накачкой, поскольку требуемая для его работы удельная мощность энерговклада в газовую среду (менее 10 кВт/см³) достижима для существующих импульсных ядерных реакторов. Для проверки этого предположения были поведены эксперименты на ядерном реакторе «Барс-6» по накачке газовой смеси Ar-Xe-CCl₄ продуктами ядерной реакции ²³⁵U(n, f).

3.2. Результаты экспериментов по накачке эксимерных молекул XeCl * осколками деления $^{235}\mathrm{U}$

Лазерный элемент размещался вблизи активных зон двухзонного ядерного реактора «Барс-6» на расстоянии 45 см от их боковой поверхности [13]. Усредненная по длине лазерного элемента пиковая удельная мощность энерговклада в активную среду лазера для номинального нейтронного импульса реактора (2 × 10¹⁷ делений в обеих зонах реактора) составляла 300 Вт/см³. Резонатор лазерного элемента образовывали узкополосные зеркала с многослойными диэлектрическими покрытиями, имеющие максимальные коэффициенты отражения в области 308 нм. Использовались три комплекта таких зеркал со следующими коэффициентами отражения: 1) 99.5 % и 99 % на λ = 308 нм с пропусканием выходного зеркала T = 0.3 % на λ = 308 нм и пропусканием 60%–80% в остальной части спектра; 2) 99.5 % и 98.25 % на λ = 308 нм с пропусканием выходного зеркала T = 1.4%; 3) 99.5 % на λ = 308 нм и кварцевым окном в качестве выходного зеркала с пропусканием T = 91.3%.

Регистрация спектрального состава излучения проводилась с помощью спектрометра МАУА-2000Рго. Монохроматор МДР-52 с фотоумножителем использовался для временных измерений интенсивности излучения на длине волны 308 нм. Оба прибора размещались на расстоянии ~20 м от выходного зеркала лазерного элемента. Термопарный измеритель энергии излучения с узкополосным отражательным фильтром на $\lambda = 308$ нм устанавливался на расстоянии 2 м от выходного зеркала. Форма реакторного нейтронного импульса в замедлителе нейтронов регистрировалась камерой деления КНТ-5.

Основные результаты представлены на рис.6, 7. Осциллограммы импульса тепловых нейтронов накачки и импульса излучения лазерного элемента ($\lambda = 308$ нм) при накачке осколками деления урана представлены на рис.6, а спектрограммы выходного излучения лазерного элемента с резонаторами указанных трех типов – на рис.7. Следует отметить сужение спектральной ширины полосы излучения при $\lambda = 308$ нм и увеличение ее интенсивности с увеличением пропускания выходного зеркала. Наибольшая интенсивность выходного излучения достигается при использовании в качестве выходного зеркала кварцевого окна (рис. 7, в). В этом случае выходное излучение формируется в основном за два прохода внутри лазерного элемента, причем интенсивность этого излучения мало отличается от интенсивности внутрирезонаторного излучения, полученной изспектров рис. 7, а, б с учетом пропускания сильно отражающих зеркал. Это указывает на возникновение в лазерном элементе длиной 250 см при накачке осколками деления урана режима усиленного спонтанного излучения. Измеренная с кварцевым окном и пересчитан-



Рис.6. Осциллограммы импульса нейтронов накачки «БАРС-6» (*a*) и импульса лазерного излучения на длине волны 308 нм (δ).



Рис.7. Спектры выходного излучения лазерного элемента длиной 250 см с резонатором, образованным глухим зеркалом (R = 99.5%) и выходным зеркалом с T = 0.3% (a), 1.4% (δ) и 91.3% (b); накачка производится осколками деления урана с мощностью удельного энерговклада в газ ~300 Вт/см³. Спектры a и δ взаимно нормированы.

ная с учетом геометрии измерений мощность этого излучения составила 40-50 кBt/cp с длительностью импульса по основанию ~200 мкс при эффективности флуоресценции на B-X-переходе молекулы XeCl^{*}, равной ~10%.

Могут возникнуть вопросы о стабильности свойств газовых смесей с низким содержанием донора CCl₄, о возможном выгорании этого компонента в процессе накачки и о его радиационной стойкости. Известны три экспериментальные работы [19–21], в которых рассматривались эти вопросы и где не было обнаружено каких-либо препятствий для использования малых концентраций донора CCl₄ (~30 мTор) в условиях накачки осколками деления урана [19] и продуктами ядерной реакции ³He(n, p)³T [20, 21]. Эксперименты, выполненные в настоящей работе, подтвердили длительную сохранность газовой смеси Ar–Xe–CCl₄ (в течение 30 суток) и возможность ее многократного использования при накачке импульсным электронным пучком и продуктами ядерной реакции ²³⁵U(n,f).

4. Заключение

Экспериментальные исследования люминесценции газовых смесей $Xe-CCl_4$ и $Ar-Xe-CCl_4$, проведенные при их накачке импульсным пучком быстрых электронов, показали, что для получения эффективной работы лазера на B-X-переходе молекулы $XeCl^*$ ($\lambda = 308$ нм) с использованием газовых смесей Ar-Xe-CCl4 и Xe-CCl4 необходимо поддерживать в смеси низкое парциальное давление хлорсодержащего донора $\operatorname{CCl}_4(p_{\operatorname{CCl}_4} \ll 1 \operatorname{Top})$ и низкое парциальное давление Xe ($p_{Xe} \sim 12$ Top). При накачке таких бедных газовых смесей импульсным пучком быстрых электронов умеренной мощности ($E_e = 150$ кэB, $I_{av} = 0.4$ A, $T_{\rm p} = 5$ нс) и удельном энерговкладе в газ менее 7 кВт/см³ в кювете длиной 4 см была получена квазинепрерывная лазерная генерация на B-X-переходе молекулы XeCl^{*} (λ = 308 нм) с коэффициентом усиления $\alpha = 0.0085$ см⁻¹ и эффективностью флуоресценции $\eta \sim 10\%$. При накачке газовых смесей Ar-Xe-CCl₄ осколками деления урана, образующимися при облучении слоя урана импульсом тепловых нейтронов с энерговкладами в газ ~300 Вт/см³ в кювете длиной 250 см в резонаторе с глухим зеркалом и кварцевым окном на B-X-переходе молекулы $XeCl^*$ ($\lambda =$ 308 нм), был зарегистрирован режим усиленного спонтанного излучения с выходной мощностью светового излучения 40-50 кВт/ср и длительностью импульса по основанию ~200 мкс при эффективности флуоресценции на **B**–Х-переходе молекулы XeCl^{*} $\eta \sim 10\%$.

Полученные в работе экспериментальные результаты открывают возможность создания эффективного эксимерного лазера с ядерной накачкой на B–X-переходе молекулы XeCl* (λ = 308 нм), поскольку требуемая для его работы удельная мощность энерговклада в газовую среду (менее 10 кBт/см³) достижима для существующих импульсных ядерных реакторов.

Авторы выражают глубокую благодарность Б.П.Меркулову (ООО «Плазма», Рязань) за техническую помощь и полезные консультации по работе импульсного ускорителя электронов.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 12-02-00382-а).

- Мельников С.П., Сизов А.Н., Синянский А.А. Лазеры с ядерной накачкой (Саров: изд-е РФЯЦ ВНИИЭФ, 2008, с. 439).
- Загидулин А.В., Бочков А.В., Мироненко В.В., Софиенко Г.С. Письма в ЖТФ, 38 (23), 31 (2012).
- 3. Эксимерные лазеры. Под ред. Ч.Роудза (М.: Мир, 1981, с. 245).
- 4. Мавлютов А.А. и др. ПТЭ, № 3, 114 (2001).
- Хьюбер К.-П., Герцберг Г. Константы двухатомных молекул (в двух частях). Пер. с англ. под ред. Н.Н.Соболева (М.: Мир, 1984, с. 366).
- 6. Abdullin E.N., Ivanov N.G., et al. Laser Phys., 16, 89 (2006).
- 7. Tang K.Y., Lorents D.C., Huestis D.L. Appl. Phys. Lett., 36 (5), 347 (1980).
- 8. Tittel F.K. et al. Appl. Phys. Lett., 36 (6), 405 (1980).
- 9. Marowsky G. et al. Chem. Phys. Lett., 98 (2), 167 (1983).
- Миськевич А.И., Го Цзиньбо. Квантовая электроника, 43, 489 (2013).
- 11. Миськевич А.И., Го Цзиньбо. Письма в ЖТФ, **39** (8), 33 (2013).
- Копай-Гора А.П., Миськевич А.И., Саламаха Б.С. ПТЭ, № 5, 171 (1986).
- Дюжов Ю.А., Кухарчук О.Ф., Полетаев Е.Д., Смольский В.Н. и др. Квантовая электроника, 40, 11 (2010).
- 14. Johnson T.H., Cartiand H.E., et al. Appl. Phys. Lett., 66, 5707 (1989).
- 15. Kolts J.H., Velazco J.E., Setser D.W. J. Chem. Phys., 71, 1247 (1979).
- 16. Bennett W.R. Jr. Ann. Phys., 18, 367 (1962).
- 17. Scheunemann H.-U. et al. Phys. Chem., 84, 580 (1980).
- 18. Braun M. et al. J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys., 42, 125202 (2009).
- Мельников С.П., Порхаев В.В. Труды II междунар. конф. «Физика ядерно-возбуждаемой плазмы и проблемы лазеров с ядерной накачкой (Арзамас-16, 1995, т. 1, с. 307).
- Хасенов М.У., Накискожаев М.Т., Сырлыбаев А.С., Смирнова И.И. Оптика атмосферы и океана, 22, 1057 (2009).
- 21. Мавлютов А.А., Миськевич А.И. *Письма в ЖТФ*, 22 (8), 48 (1996).